

次世代露光技術の開発

半導体製造におけるリソグラフィ(露光)プロセスの開発に従事してきた。微細な回路パターンを高い歩留まりで刻むために、膨大なシミュレーションを繰り返して最適な設計・露光条件・原版形状などを求める工程が必要であり、この計算機リソグラフィと呼ばれる技術を担当。現在は次世代露光技術の開発にも携わり、日々難題に取り組んでいる。

修士では生命工学を学び、全く異なる分野に就職したが、身につけた研究の手法はそのままプロセス開発に活

凛としていきる

理系女性の挑戦

手を抜かず、無理しすぎず

かすことができた。初社会人博士課程に挑戦するための海外国際学会での発表では、上司をはじめ周囲の方々がこぞって指導・育成してくださった。恵まれた環境だったが、デバイス開発計画や景気の動向に翻弄される日々もあった。

30代後半に上司から

社長、半導体関連委員会の委員などをお受けしてきた。若い方々にも、機会があればぜひ挑戦してほしい。きっと世界が広がり、一歩を踏み出す自信につながるはずだ。



後には社内外の依頼があり、国際学会の委員・サンノゼの国際学会にて座長を務めた

ただき、学位を取得することができた。その後は社内外の依頼があり、国際学会の委員・サンノゼの国際学会にて座長を務めた

職。ベビーシッターを活用し、海外出張の時は双方の両親に助けを求めながら、綱渡りで乗り切った。夜遅くまでの会議を終えて帰宅すると、待ちくたびれた子供の寝顔には涙の跡。仕事の成果を上げるために最大限の努力を重ねてきたが、いつも悩みの種は、バランスのとおり方であった。種々のサポート環境を享受しつつ、欲張って無理をしないか、という葛藤である。

ここで相談できる「斜めの関係」が貴重であった。家族と周囲の支えに感謝しつつ、今後も「決して手を抜かず、無理しすぎず」で引き続き技術の発展に寄与していきたい。企画協力・日本女性技術者フォーラム(JWEF) (火曜日に掲載)

東芝セミコンダクター&ストレージ社 半導体研究開発センター 主査 小林 幸子

〈プロフィール〉94年 東大院工学系研究科工業化学専攻修了、東芝*入社。先端半導体リソグラフィプロセス開発に従事。博士(工学)。*JWEF 法人会員。

